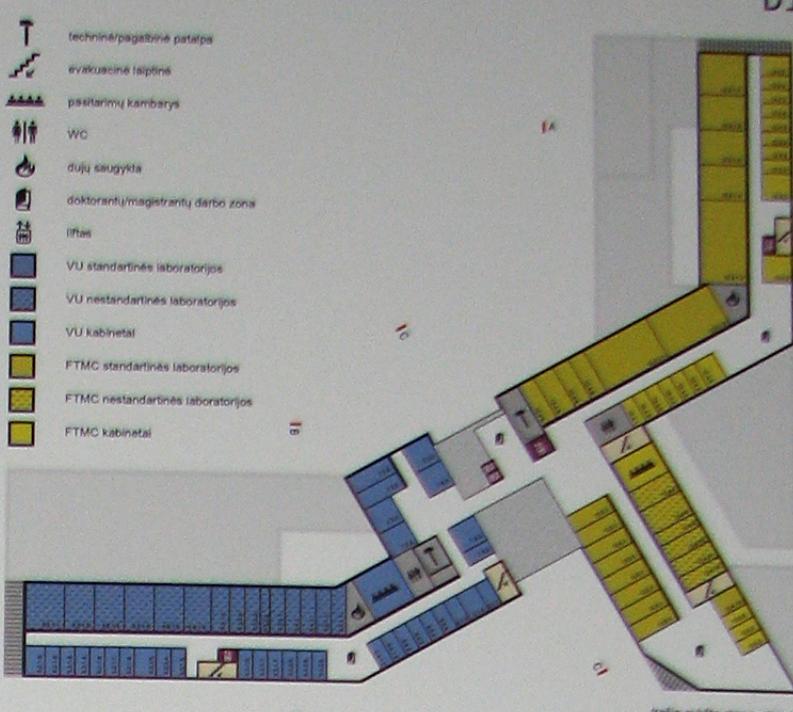


pirmo aukšto plano schema M1:500

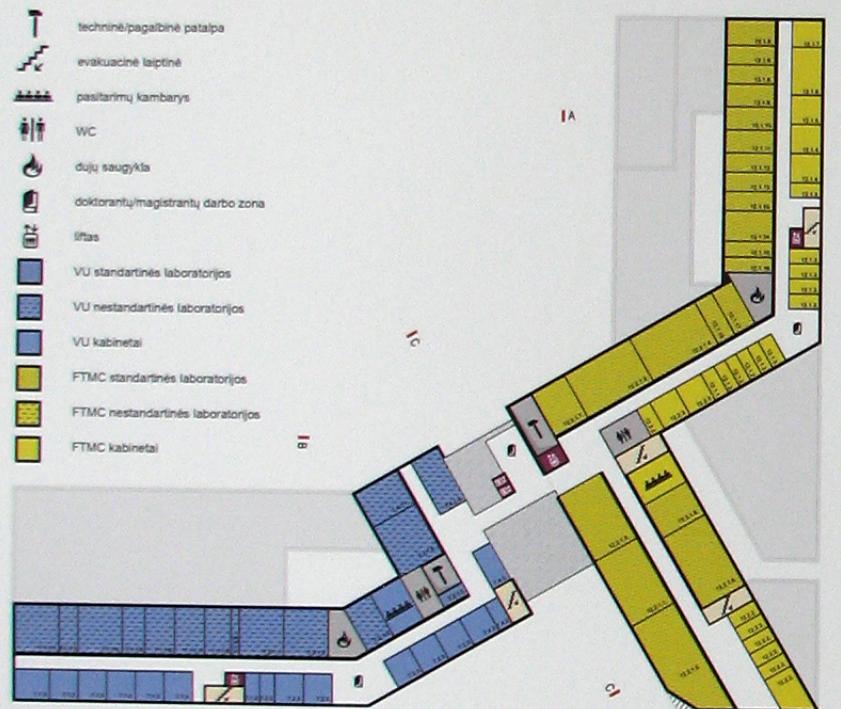


treccio multilayer scheme M1-500

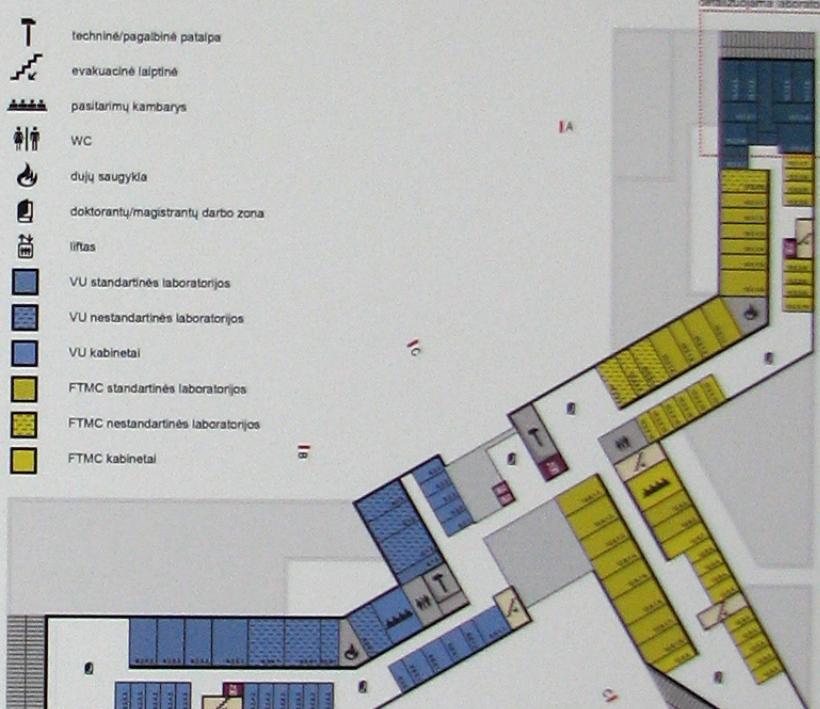
1.1. Cintas direktoriaus Kabinetas, 12 m²
1.2. Priešgaisrinės medžiagos laikas 24 m²
1.3. Užterštukai
1.4. Akmens plyninių vachyminkas, 12 m²
1.5. Priesgaisrūs, sienos 24 m²
1.6. Medžiagų sandėlis 12 m²
1.7. Gaminimo, 8 m²
2.1. 4 (šios) ištaisymo 24 m²
2.2. Patalpa buveinė bei arčiausios reikimams 15 m²
2.3. Priešgaisrinės medžiagos laikymo 15 m²
2.4. Patalpa elektronikai 12 m²
2.5. Patalpa sandėliuoti 12 m²
2.6. Dėmėjimo 30 m²
2.7. Priešgaisrinės medžiagos laikymo 12 m²
2.8. Patalpa išsiųsti kiekvienam pastatu aukščio 30 m²
2.9. Sandėlis keli invertoriui 20 m²
2.10. Mėsos laikymo pastatas (nuostipus medžiagoms) 100 m²
2.10.2.1 REBER M 1000 (nuostipus medžiagoms) 40 m²
2.10.2.2 pagalbinės patalpos technologiniams blokui 18 m²
2.10.2.3 Optinis mikrospalvis (Lietz) 12 m²
2.10.2.4 MOVIDO mikrospalvis (nuostipus medžiagoms) 80 m²
3.1.1.2 Priešgaisrinės medžiagos laikymo 12 m²
3.1.1.2.1 CVD rezistencinis, OPTIV rezistencinis su GX3 100 m²
3.1.1.2.2 Pagalbinės patalpos 20 m²
3.1.1.2.3 Priešgaisrinės medžiagos laikymo (nuostipus medžiagoms) 30 m²
3.1.2.1 ERF patalpos (nuostipus medžiagoms) 30 m²
3.1.2.2.1 CVD rezistencinis (nuostipus medžiagoms) 30 m²
3.1.2.2.2 Pagalbinės patalpos 20 m²

5.1.1 Direktores 12 m²
 5.1.2 Admin darbuvių 18 m²
 5.2 Pregabulinės patalpos 12 m²
 5.2.1 Puslaidinėsios patalpos minkščiausios spektroje
 5.2.2 Elektronikos konstrukcinių laboratorijų
 5.2.3 Elektr. parametruose išanalizavimo laboratorija
 5.2.4 Fotoleitinėsios reakcijos laboratorija 40 m²
 5.2.5 Elektronikos charakterizavimo laboratorija 43 m²
 5.2.6 Sklypus vedičias 12 m²
 5.2.7 Sertifikacijos laboratorija 12 m²
 5.2.8 Mokslinės laboratorijos 60 m²
 5.2.9 Seitorius vedičias 12 m²
 5.2.10 Mokslinės laboratorijos 16 m²
 5.2.11 Elektronikos teichologijos (lab. 26 m²)
 5.2.12 Elektronikos teichologijos (lab. 24 m²)
 5.3 Sklypus vedičias 12 m²
 5.3.1 Seitorius vedičias 12 m²
 5.3.2 Mokslinės laboratorijos 24 m²
 5.3.3 Elektronikos konstrukcinių laboratorijos 20 m²

12.3.1.7 *Pseudotachyspilus* 100 ml
 12.3.2 *Mesoleptus dentatus* maledictus 20 ml
 12.3.3 *Leptothrix* sp. 10 ml
 12.4.1 *Lathrobium* vestitum laticollis 12 ml
 12.4.2 *Mesoleptus dentatus* maledictus 20 ml
 12.4.3 *Leptothrix* sp. 10 ml
 12.4.4 *Vidalia* sp. 2 ml
 12.4.5 *Phalacrus* heteropterus heteropterus 10 ml
 12.4.6 *Phalacrus* heteropterus heteropterus 10 ml
 12.4.7 *Phalacrus* heteropterus heteropterus 10 ml
 12.4.8 *Phalacrus* heteropterus heteropterus 10 ml
 12.4.9 *Phalacrus* heteropterus heteropterus 10 ml
 12.4.10 *Phalacrus* heteropterus heteropterus 10 ml
 12.4.11 *Phalacrus* heteropterus heteropterus 10 ml
 12.4.12 *Phalacrus* heteropterus heteropterus 10 ml
 12.4.13 *Phalacrus* heteropterus heteropterus 10 ml
 12.5.1 *Metaphycus* lateralis 10 ml
 12.5.2 *Metaphycus* lateralis 10 ml



www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/111-500



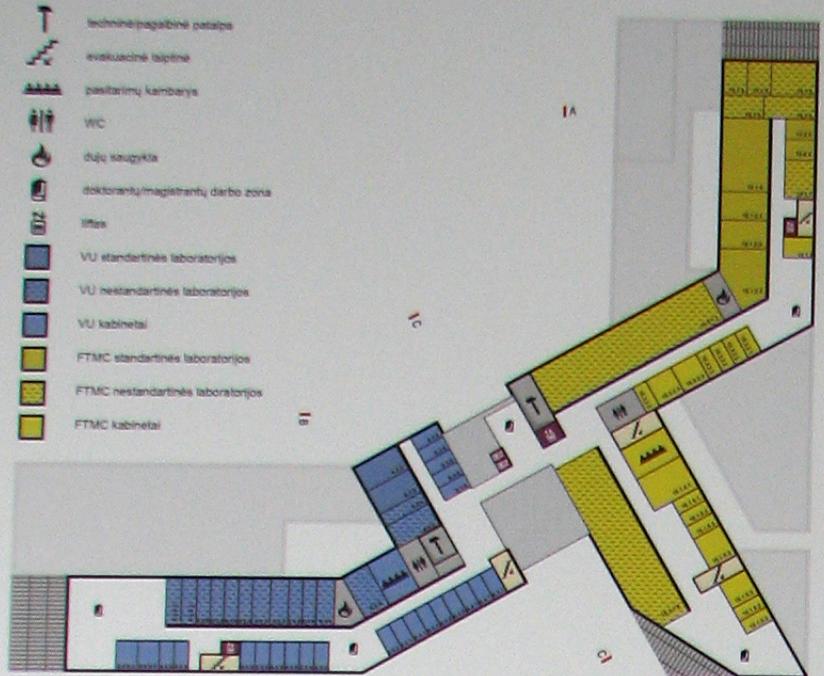
100

- 7.1.1.1 MOC/D laboratorija 80 m²
- 7.1.1.2 Metalurginių įrangos vinkščiaus laboratorija 20 m²
- 7.1.1.3 Cheminių sintetikų laboratorija 60 m²
- 7.1.1.4 Terminių laboratorių 30 m²
- 7.1.1.5 Klimatinių vinkščių laboratorija 40 m²
- 7.1.1.6 Medžiagų analizės laboratorija 40 m²
- 7.1.1.7 Angliškų pagalbos laboratorija 30 m²
- 7.1.1.8 Techninės patologijos (Riegertų sandėlyje) 10 m²
- 7.1.1.9 Biologinių vinkščių laboratorija 12 m²
- 7.1.2.1 Mokslinės vinkščių laboratorija 144 m²
- 7.1.2.2 Chromatografinės analizės laboratorija 40 m²
- 7.1.2.3 Spektroskopinės analizės laboratorija 80 m²
- 7.1.2.4 Elektroninės mikroskopijos laboratorija 40 m²
- 7.1.2.5 Biologinių vinkščių laboratorija 10 m²
- 7.2.1.2 Techninės patologijos (Riegertų sandėlyje) 12 m²
- 7.2.2.2 Vadovaujantys mokslo (Riegertų sandėlyje) kabinetai 12 m²

- 7.1.1. Medžiagų ir paruošimų išmėjimų laboratorija 50 m²
- 7.1.2. Elektrosenergijos siuntėjimo laboratorija 50 m²
- 7.4.2. Vadovaujantys mokslininkai kabinetas 12 m²
- 7.4.3. Molio darbuotojų kabinetas 40 m²
- 7.12.1. Laboratorių vadovo kabinetas 12 m²
- 7.12.2. Mokslininko kabinetas 40 m²
- 7.12.3. Molio darbuotojų kabinetas 72 m²
- 7.12.4. Tinklų darbo kabinetas 48 m²
- 7.12.5. Doktorantu darbo kabinetas 24 m²
- 7.17. Magnetinių palapinių 40 m²
- 7.17.1. Magnetinių palapinių 18 m²
- 7.18. Kanzelės ir wechslerių išmėjimų lab., patalpose 75 m²
- 7.19. Fotosekretorinių išmėjimų laboratorijos patalpos 30 m²
- 7.20. Magnetinius dualkamerūs įrenginiai patalpose 30 m²
- 7.21. Aukštikalnių žemėlapių išmėjimų laboratorijos pat. 30 m²
- 7.22. Pasielių, pagrindinių išmėjimų dualkamerūs įrenginiai pat. 30 m²



D1G1T5



penktos aukštės plano schema M1:500

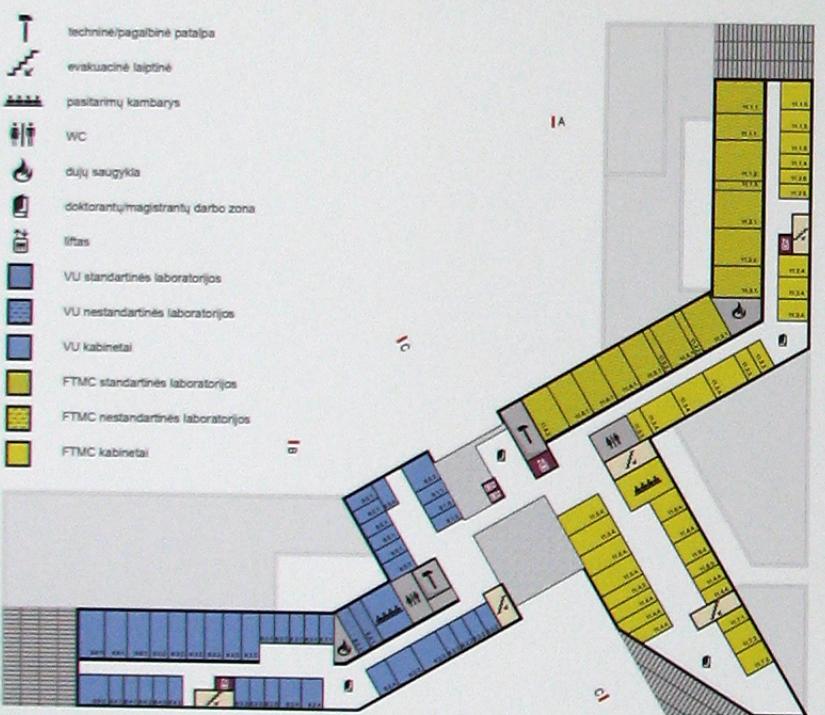
- 8.3.1. Katedros vedybos kabinetas 12 m²
 8.3.2. Mokslo darbuotojų laboratorija 36 m²
 8.3.3. Užsieninės optikos laboratorija 36 m²
 8.3.4. FTMC standartinės laboratorijos 18 m²
 8.3.5. FTMC nestandartinės laboratorijos 18 m²
 8.3.6. Mokslo darbuotojų kabinetas 30 m²
 8.3.7. Mokslo darbuotojų kabinetas 30 m²
 8.3.8. Katedros vedybos kabinetas 12 m²
 8.3.9. Nestandartinės optikos laboratorija 42 m²
 8.3.10. Užsieninės optikos laboratorijos 42 m²
 8.4.1. Apieprėmimo salė 18 m²
 8.4.2. Laboratorių vedybos kabinetas 100 m²
 8.4.3. Laboratorių vedybos kabinetas 24 m²
 8.4.4. Mokslo darbuotojų kabinetas 24 m²
 8.4.5. LPE įrangos patalpos 20 m²
- 8.3.1. Katedros vedybos kabinetas 12 m²
 8.3.2. Katedros vedybos hankytų kabinetas 12 m²
 8.3.3. Elektronografijos laboratorija N1.01 ir N1.02 48 m²
 8.3.4. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.3.5. Techninės patalpos 40 m²
 8.3.6. Techninės patalpos 40 m²
 8.3.7. Mokslo darbuotojų kabinetas 36 m²
 8.3.8. Mokslo darbuotojų kabinetas 36 m²
 8.3.9. Elektronografijos laboratorija 40 m²
 8.3.10. Nestandartinės optikos laboratorija 36 m²
 8.3.11. Elektr. serviso gaminio patalpos 30 m²
 8.3.12. Elektronografijos laboratorija 42 m²
 8.3.13. Apieprėmimo salė 18 m²
 8.3.14. Katedros vedybos kabinetas 100 m²
 8.3.15. Mokslo darbuotojų kabinetas 24 m²
 8.3.16. LPE įrangos patalpos 48 m²



septintos aukštės plano schema M1:500

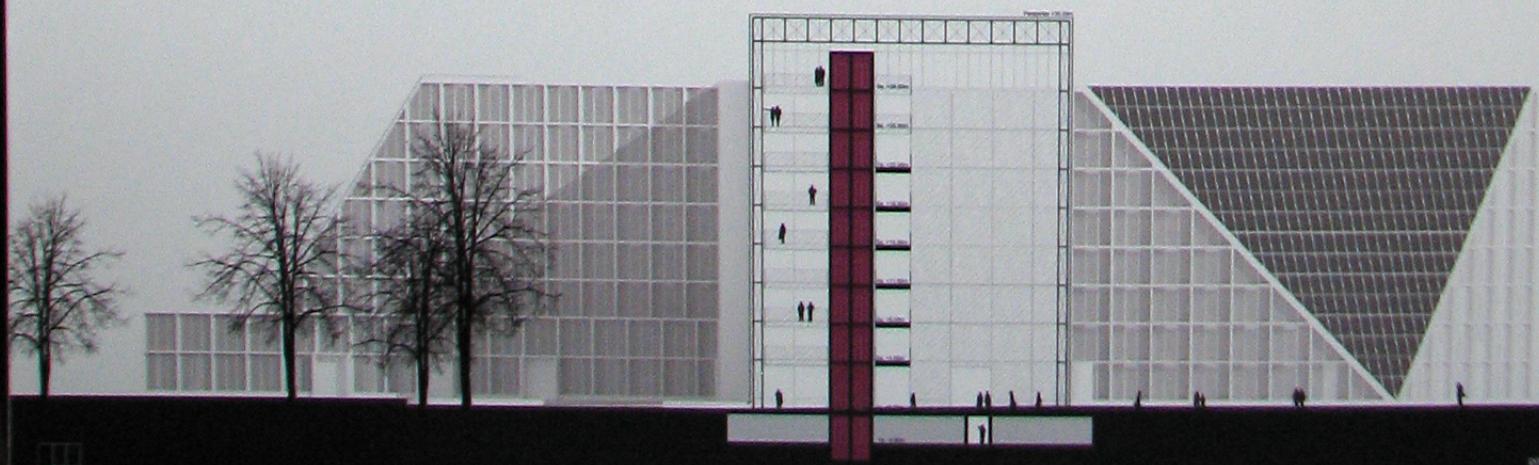
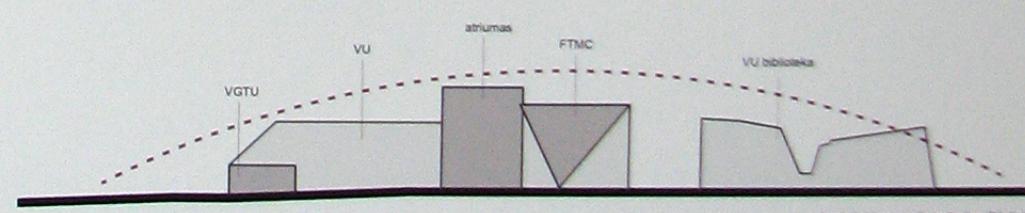
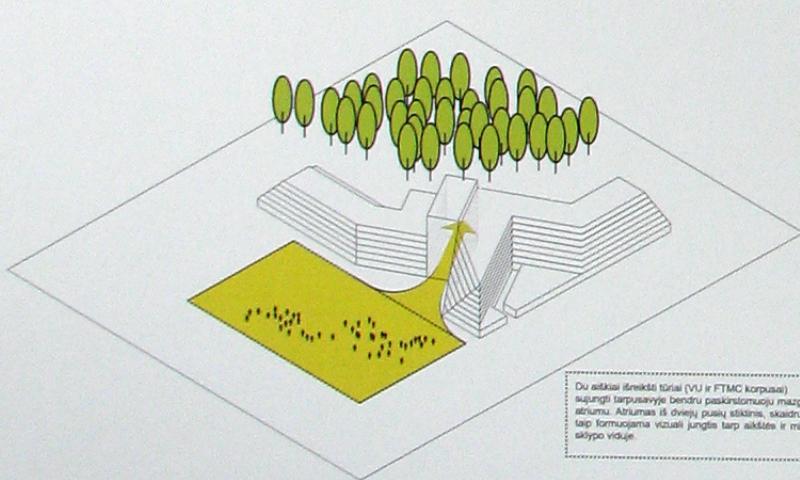
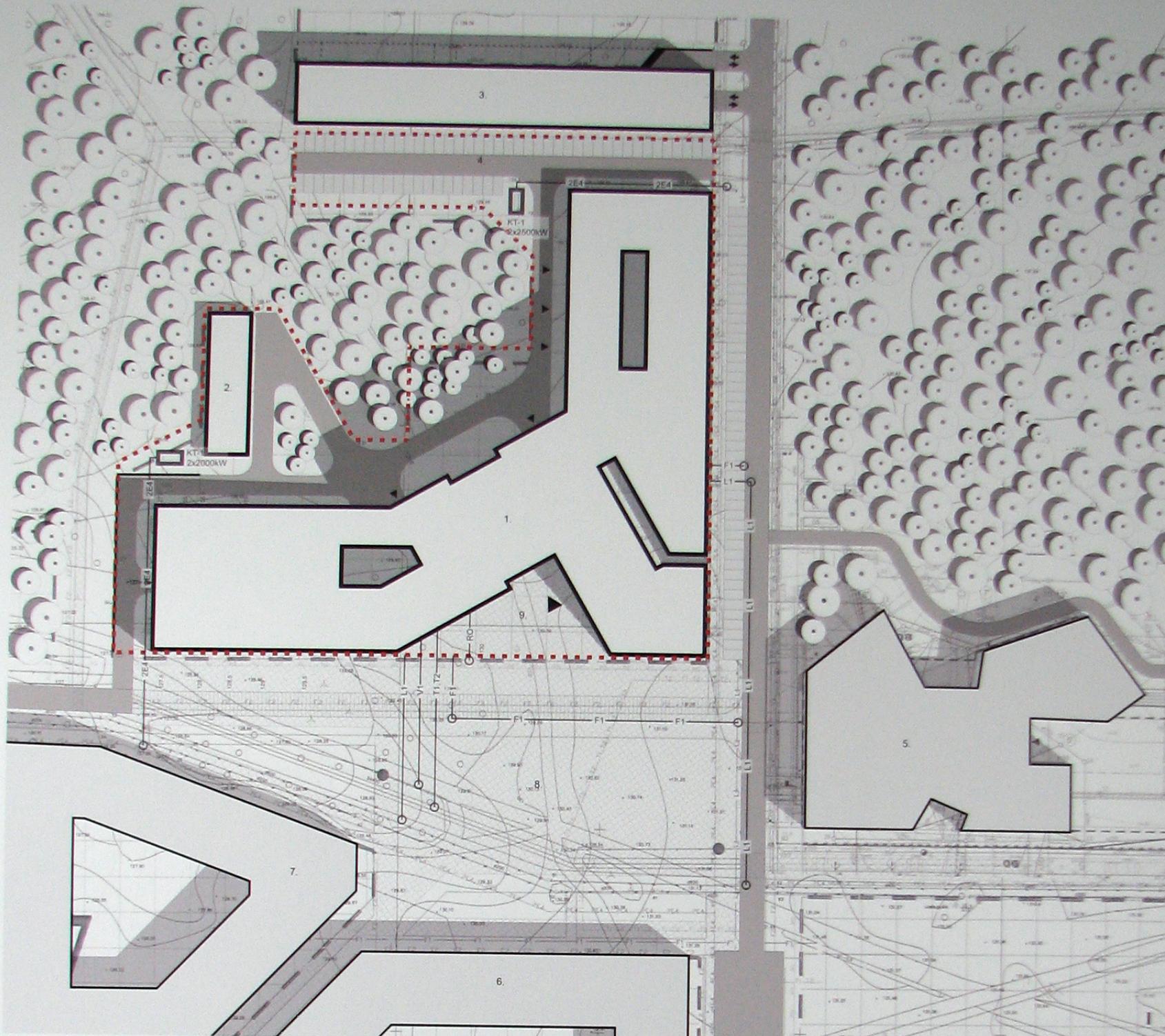
- 11.9.1. Laboratorių patalpos 75 m²
 11.9.2. Lab. vedybos kabinetas 12 m²
 11.9.3. Mokslo darbuotojų kabinetas 60 m²
 11.9.4. Laboratorių patalpos 108 m²
 11.9.5. Beidoktorinė kamera 38 m²
 11.9.6. Techninės patalpos 62 m²
 11.9.7. Lab. vedybos kabinetas 12 m²
- 11.9.8.1. Mokslo darbuotojų kabinetas 48 m²
 11.9.8.2. Lab. vedybos kabinetas 12 m²
 11.9.8.3. Mokslo darbuotojų kabinetas 60 m²
 11.9.9.1. Optinė elementų atspurinio lazerinės spindulinės tyrimo laboratorija 12 m²
 11.9.9.2. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 11.9.9.3. Elektronografijos laboratorija 40 m²
 11.9.9.4. Mokslo darbuotojų kabinetas 48 m²
 11.9.9.5. Lab. vedybos kabinetas 12 m²

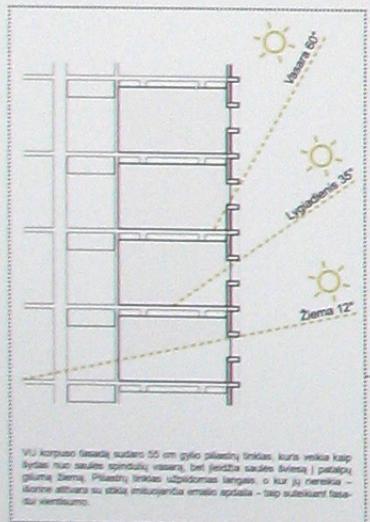
- 11.11.5. Lab. vedybos kabinetas 12 m²
 11.11.6. Mokslo darbuotojų kabinetas 60 m²
 11.12.1. Laboratorių patalpos 108 m²
 11.12.2. Beidoktorinė kamera 38 m²
 11.12.3. Techninės patalpos 40 m²
 11.12.4. Lab. vedybos kabinetas 12 m²
 11.12.5. Mokslo darbuotojų kabinetas 60 m²
 11.12.6. Techninės patalpos 10 m²



šeštos aukštės plano schema M1:500

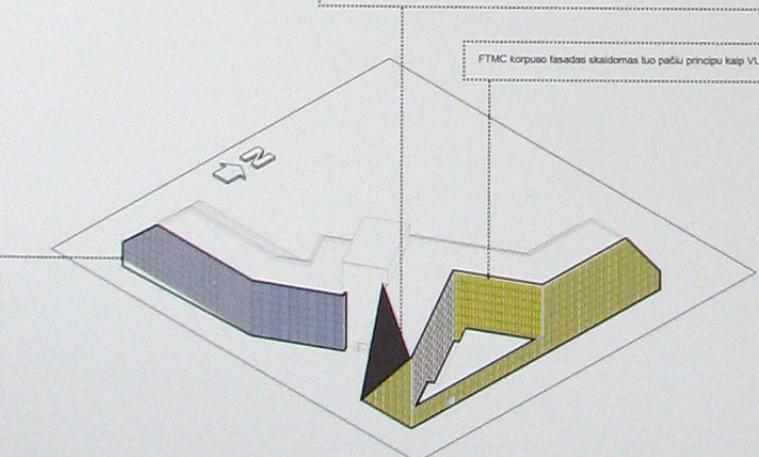
- 8.1.1. Direktorius 12 m²
 8.1.2. Direktorinės pavaduotės 12 m²
 8.1.3. Geometrinės 12 m²
 8.1.4. Skrytinės 12 m²
 8.1.5. Vystymosi mokslo darbuotojų kabinetas 48 m²
 8.1.6. Mokslo darbuotojų kabinetas 54 m²
 8.1.7. Mokslo darbuotojų kabinetas 60 m²
 8.1.8. Vystymosi mokslo darbuotojų kabinetas 60 m²
 8.1.9. Vystymosi mokslo darbuotojų kabinetas 144 m²
 8.1.10. Vystymosi mokslo darbuotojų kabinetas 24 m²
 8.1.11. Vystymosi mokslo darbuotojų kabinetas 24 m²
 8.1.12. Vystymosi mokslo darbuotojų kabinetas 12 m²
 8.1.13. Skrytinės 12 m²
 8.1.14. Vystymosi mokslo darbuotojų kabinetas 24 m²
 8.1.15. Vystymosi mokslo darbuotojų kabinetas 24 m²
- 8.5.1. Mokslo darbuotojų kabinetas 12 m²
 8.5.2. Kompiuterių klasės kabinetas 50 m²
 8.6.1. Kompiuterių specialistų kabinetas 18 m²
 8.6.2. Kompiuterių specialistų kabinetas 18 m²
 8.6.3. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.4. Elektronografijos laboratorija 70 m²
 8.6.5. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.6. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.7. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.8. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.9. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.10. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.11. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.12. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.13. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.14. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.15. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.16. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.17. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.18. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.19. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.20. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.21. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.22. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.23. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.24. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.25. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.26. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.27. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.28. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.29. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.30. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.31. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.32. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.33. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.34. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.35. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.36. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.37. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.38. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.39. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.40. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.41. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.42. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.43. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.44. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.45. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.46. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.47. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.48. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.49. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.50. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.51. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.52. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.53. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.54. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.55. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.56. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.57. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.58. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.59. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.60. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.61. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.62. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.63. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.64. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.65. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.66. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.67. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.68. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.69. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.70. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.71. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.72. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.73. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.74. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.75. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.76. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.77. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.78. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.79. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.80. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.81. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.82. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.83. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.84. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.85. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.86. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.87. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.88. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.89. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.90. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.91. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.92. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.93. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.94. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.95. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.96. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.97. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.98. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.99. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.100. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.101. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.102. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.103. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.104. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.105. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.106. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.107. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.108. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.109. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.110. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.111. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.112. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.113. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.114. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.115. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.116. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.117. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.118. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.119. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.120. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.121. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.122. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.123. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.124. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.125. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.126. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.127. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.128. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.129. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.130. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m²
 8.6.131. Elektronografijos relikcijų lab. 30 m<sup





Prieinėje FTMC korpuso dalyje suformuota trikampė, į saulę atgręžta plakštuma, kurioje esama galimybė atlikti fildetų saulės kolektorių ar baterijos ar išbandyti naujų FTMC sunkutės energijos kaupimo ir panaudojimo technologijas. Šiuo metu dalyje plakštumos numatyta įrengti saulės baterijas, kurių sukaupta energija būtų panaudojama naikintiniams pastalo fasadų apšvietimui LED tipo lėvurų.¹

FTMC korpuso fasadas skaidomas tuo pačiu principu kaip VU tik vertikaliai.



laboratorija

sviesa
kabinetas

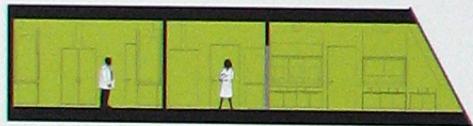
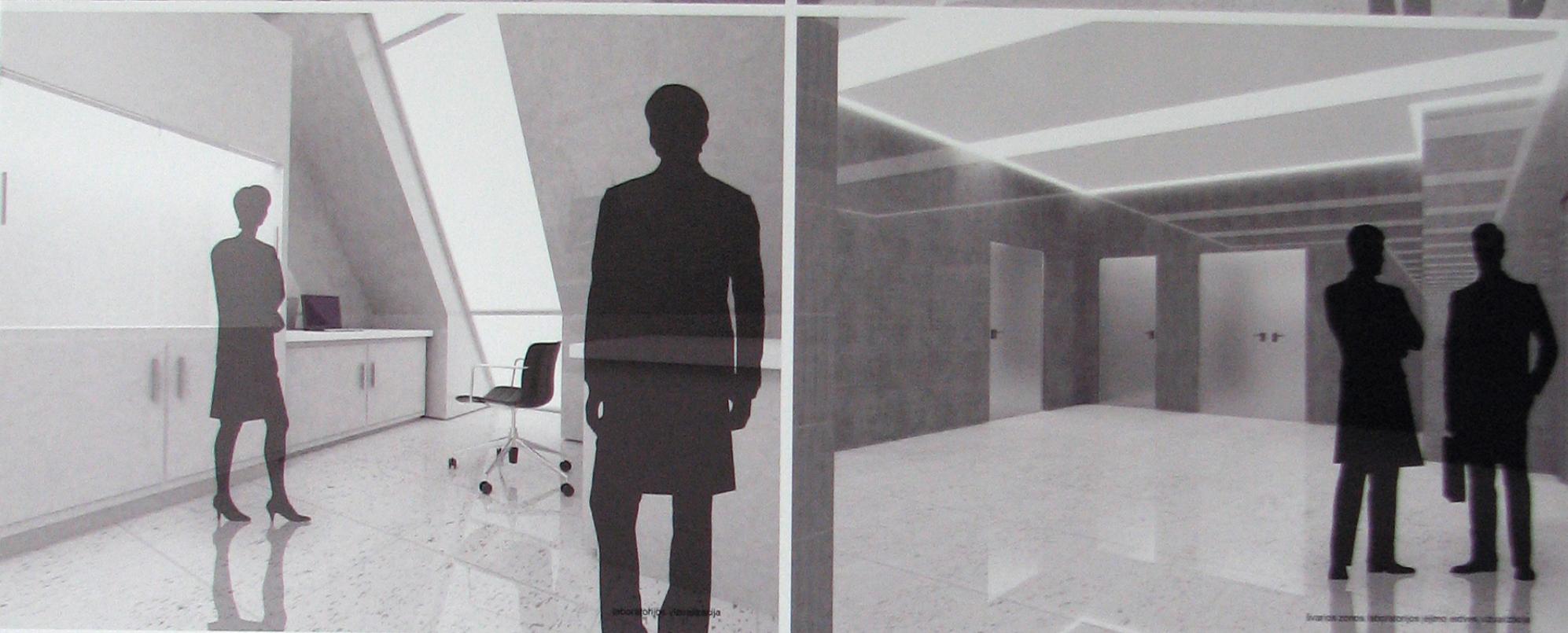
[Profilo per conoscere i dettagli](#)

principielle inßinerie in technologische systeme. Schreibe mir schme

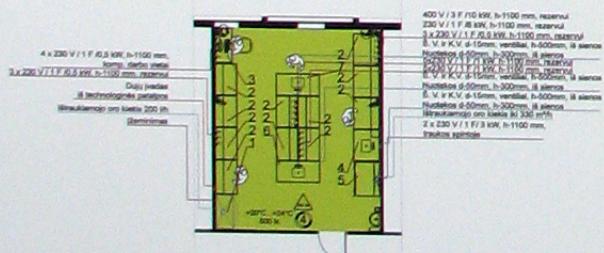


Viril primo osztály körülbelül 10000 eleme, négyzetméterben. A gyártásban használt technikai eszközökkel, műszereivel, technológiával, termékekkel, szolgáltatásokkal, alkalmazottakkel, kölcsönös munkahelyekkel foglalkozik. Az önkormányzatnak minden területén elérhető a vállalkozásnak a hivatalos támogatásai.





detaлизuotos nestandardinės laboratorijos 10.1.2 pjūvis D-D M1:100



standardes laboratorios detallazia M1-100

